(54) PRESSURE-SENSITIVE ADHESI

VE ADHESI IAGNETIC SHEET

(11) 62-43481 (A)

(43) 25.2.1987

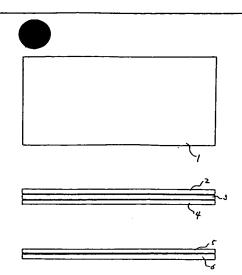
(21) Appl. No. 60-183485 (22) 21.8.1985

(71) BUHEI AKAHA (72) BUHEI AKAHA (51) Int. Cl\*. C09J7/02

PURPOSE: To provide the titled magnetic adhesive attached with a magnetic pressure-sensitive adhesive sheet or pressure-sensitive adhesive agent, usable as a long continuous tape, removable easily by selecting a proper pressure-sensitive adhesive agent and cuttable to a desired length.

CONSTITUTION: The objective sheet 1 can be produced by laminating a magnet 2 with a pressure-sensitive adhesive sheet or a pressure-sensitive adhesive agent. The pressure-sensitive adhesive agent may be provided with a releasing paper

7.



## BEST AVAILABLE COPY

(54) ABRASION WORKING FLUID

(11) 62-43482 (A)

(43) 25.2.1987 (19) JP

(21) Appl. No. 60-184654 (22) 21.8.1985

(71) SANYO CHEM IND LTD (72) FUMIHIDE GENJIDA(1)

(51) Int. Cl4. C09K3/14,B24B37/00

PURPOSE: To provide an abrasion working fluid containing a water-soluble polymeric dispersant, a permeating surfactant, water and diamond abrasive grains, having high dispersion stability, free from the precipitation of the abrasive grain with time and effective to remarkably improve the efficiency of abrasion work.

CONSTITUTION: The objective working fluid contains (A) a water-soluble polymeric dispersant [preferably polyvinyl pyrrolidone, polyethylene glycol and/or a water-soluble polymer containing, as essential constituent component, a monoethylenic unsaturated monomer having a group selected from carboxylic acid (salt) group, amino, hydroxyl, ether group, amide group and quaternary ammonium salt group], (B) a permeating surfactant (preferably sulfosuccinic acid ester salt, alkylbenzenesulfonic acid salt, etc.), (C) water and (D) diamond abrasive grains. The content of the component A in the liquid is preferably  $0.1 \sim 50 \text{(wt)}\%$  and that of the component B is preferably  $0.1 \sim 20\%$ .

(54) HEAT-RECOVERY OF COKE OVEN GAS

(11) 62-43484 (A)

(43) 25.2.1987 (19) JP

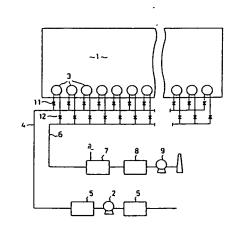
(21) Appl. No. 60-183654 (22) 21.8.1985

(71) NIPPON KOKAN K.K. <NKK> (72) KUNIHEI KOIZUMI(4)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. C10B27/00,C10B43/10

PURPOSE: To recover the sensible heat of waste coke oven gas effectively, by introducing air into the carbonization chamber after discharging the coke from a coke oven to effect the combustion and removal of carbon deposited to the wall of the chamber and, at the same time, introducing waste gas into a combustion furnace to effect the combustion of the unburnt component in the combustion waste gas.

CONSTITUTION: After discharging the produced coke from a coke oven, the door 10 of the charging hole is opened and air is introduced into the carbonization chamber 1 of the coke oven. The carbon deposited to the wall of the carbonization chamber is burnt and eliminated and, at the same time, at least a part of the coke oven gas is burnt. The combustion waste gas is introduced into the combustion furnace 7 to effect the combustion of the unburnt component of the combustion waste gas and the sensible heat is recovered. The heat-recovery of coke oven gas can be carried out by this process.



1/5/1

007096681

WPI Acc No: 1987-096678/198714

XRAM Acc No: C87-040046 XRPX Acc No: N87-072437

Polishing liq. for metal, glass, ceramic, plastics etc. -

contains dispersion of water soluble high mol. wt. substance, penetrative

surfactant, water and diamond abrasive powder Patent Assignee: SANYO CHEM IND LTD (SANN )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

✓ JP 62043482 A 19870225 JP 85184654 A 19850821 198714 B

Priority Applications (No Type Date): JP 85184654 A 19850821

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 62043482 A 6

-Abstract (Basic): JP 62043482 A

The liq. contains dispersion of water soluble high mol. wt. substance (A), penetrative surfactant (B), water and diamond abrasive powder.

Pref. content of (B) is 0.1-20 wt.% based on the liq. (B) is surfactant selected from sulphosuccinic acid ester salt, (alkyl) naphthalenesulphonic salt, its formalin condensate, alkylbenzene-sulphonic salt, alkanesulphonic salt, alkylsulphuric acid ester salt, fatty acid ester sulphate, polyoxyalkylene alkylaryl-ether and polyoxyalkylenealkylether. Content of (A) is 0.1-50 wt.% based on the liq. Pref. (A) is polyvinylpyrrolidone, polyethylene-glycol and/or water soluble polymer contg. as indispensable component, monoethylenic unsatd. monomer contg. radical of carboxylic acid, amino, hydroxyl, ether, amide or quat. ammonium salt.

USE/ADVANTAGE - The liq. is useful for polishing surface of metal, ceramic, glass, plastics, etc. The liq. has good dispersion stability, object wettability and extendability, and gives high quality polished surface.

0/0

Title Terms: POLISH; LIQUID; METAL; GLASS; CERAMIC; PLASTICS; CONTAIN; DISPERSE; WATER; SOLUBLE; HIGH; MOLECULAR; WEIGHT; SUBSTANCE; PENETRATE;

SURFACTANT; WATER; DIAMOND; ABRASION; POWDER

Derwent Class: A14; A21; A82; G02; P61

International Patent Class (Additional): B24B-037/00; C09K-003/14

File Segment: CPI; EngPI

Derwent WPI (Dialog® File 352): (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rights reserved.

#### 卵日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

### ⑫公開特許公報(A)

昭62-43482

@Int\_Cl.4

織別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)2月25日

C 09 K 3/14 B 24 B 37/00 X-6683-4H H-7712-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

**母発明の名称** 

研磨加工液

②特 類 昭60-184654

❷出 頤 昭60(1985)8月21日

伊発明者 源氏田

文 秀 京都市東山区一橋野本町11番地の1 三洋化成工業株式会

社内

**砲発明者 川内** 

宮 雄

京都市東山区一橋野本町11番地の1 三洋化成工業株式会

社内

①出 頤 人 三洋化成工業株式会社

京都市東山区一橋野本町11番地の1

明 楓 髫

1. 発明の名称

研寧加工液

#### 特許可求の範囲の範囲

1.水溶性真分子分散剤(A)、浸透性界面活性剤(D)、水およびダイヤモンド砥粒を含有することを特徴とする研察加工液。

2.(B)の含有量が加工液の重量に基いて 0.1~20 % である特許額求の範囲第1項記載の加工液。

3.(日がスルホコハク酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、(アルキル)ナフタリンスルホン酸塩、(アルキル)ナフタリンスルボン酸塩のホルマリン結合物、アルキル硫酸エステル塩、脂肪酸エステル 遊園 化物、ポリオキシアルキレンアルキルアリールエーテルおよびポリオキシアルキレンアルキルエーテルからなる群より選ばれる界面活性剤である特許譲求の範囲第1項または概2項配較の加工液。

4. (A) の含有量が加工液に基いて 0.1~5 0%である 特許請求の範囲第 1 項~第 8 項のいずれか一項に 記載の加工液。

5. (A)が(1)ポリビニルピロリドン、(2)ポリエチレングリコールおよび/または(3)カルボン酸(塩) 益、アミノ茲、水酸茲、エーテル基、アミド蒸および第4級アンモニウム塩基からなる群より選ばれる茲を含有するモノエチレン性不飽和単量体を必須構成成分とする水溶性重合体である特許請求の範囲第1項~第4項のいずれか一項に記載の加工被。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は研摩加工核に関するものである。

(従来の技術)

従来、研摩加工被としてグリセリンのような増 粘剤を加えた水に、酸化マグネンウムなどの低粒 を混合したものがあつた(特開昭 55~189479号公 報)

(発明が解决しようとする問題点)

しかしながらこのものは、低粒が経時的に沈粋 しやすい、研摩材料へのぬれ性および思着性が想 いという問題点を有している。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは砥粒が経時的に沈降しにくく、研撃材料へのぬれ性および展着性のよい研摩加工液を得るべく鋭怒検討した結果、本発明に到達した。

本発明は、水溶性高分子分散剤(以下分散剤と 路記)(A)、浸透性界面活性剤(以下浸透剤と路記) (B)、水およびダイヤモンド低粒を含有することを 特徴とする研摩加工液である。

本発明における漫画剤倒としては下記の漫画剤があげられる。

(1) アニオン界面活性剤

アニオン界面活性剤におよる塩としてはアルカリ金属(ナトリウム、カリウムなど)、アンモニウムおよびアミン(アルカノールアミンだとえばモノー.ジー,トリーエタノールアミンおよびプロパノールアミン)の塩があげられる。

1. スルホン酸塩

(1) スルホン酸エステル塩

ジアルキルスルホコハク酸エステル塩:アルキ

カンスルホン酸塩たとえばラウリルスルホン酸ナ トリウム塩など。

2 硫酸エステル塩

(1) アルキル硫酸エステル塩

炭素数が通常 6~20 の直鎖および/または分岐の飽和および/または不飽和アルコールの確酸エステル塩:具体的な化合物としてはデシルアルコール。破酸エステルナトリウム塩、セチルアルコール。破酸エステルアンモニウム塩、オキソアルコール( Cn~n、側鎖率 50%以上)硫酸エステルアンモニウム塩など。

②脂肪酸エステル硫酸化物

炭素数が通常 1~18 のアルキルアルコールと炭素数が通常 8~20 の不飽和脂肪酸とのエステルの硫酸化物。たとえばオレイン酸ブチル硫酸エステルナトリウム塩など。

(2)ノニオン界面活性剤

1. ポリオキシアルキレン来非イオン界面活性剤 (1) ポリオキシアルキレンアルキルアリールエー ル佐の戻業数は通常 6~20 : またアルキル佐にシ クロアルキル茲を含む: 具体的な化合物としてば ジオクチルスルホコハク酸エステルナトリウム塩 およびジシクロヘキシルスルホコハク酸エステル ナトリウム塩など。

- (2) アルキルペンゼンスルホン酸塩

炭素数が通常 8~20 の分岐または直鎖の 1 個および/または複数個のアルキル基を有するアルキルベンゼンスルホン酸塩:具体的な化合物としてはドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩など。

(3) ( アルキル ) ナフタリンスルホン酸塩および ( アルキル ) ナフタリンスルホン酸塩のホルマリン紹合物

ナフタリンスルホン酸または炭素效過常 1~18 の1 個および/または複数個のアルキル基を有するナフタリンスルホン酸塩およびホルマリン縮合物:具体的な化合物としてはジブチルナフタレンスルホン酸ナトリウムなど。

(4)アルカンスルホン酸塩

炭素数が通常 8~20 のアルキル店を有するアル

テル

炭素致通常 8~12 のアルキル茲を少なくとも1個有するアルキルフェノールもしくはアルキルナフトールのAO付加物(AOの付加モル政は通常2~50、好ましくは 7~20) たとえばノニルフェノールEO(8) PO(2) など(上記および以下において AOはアルキレンオキサイド、EOはエチレンオキサイド、POはプロピレンオキサイドを示す。また()内はモル致を示す。注・オクチルフェノールEO(8) PO(2) はオクチルフェノールにEO8 モルPO2 モルをこの頃に付加したものである。)

(2) ポリオキシアルキレンアルキルエーテル

脂肪族アルコール(炭素数 6-20、好ましくは 炭素数 10-18 で、直鎖、または分酸の天然また は合成アルコール)の A O 付加物。( A O の付加 モル数は通常 2-50 、好ましくは 2-20 )たとえ ぱオクチルアルコール E O (6) 、ラウリルアルコー ル E O (6) など。

とれらの浸透剤四は単独でまた二個以上の組合

せで用いられる。

これらの浸透剤因のうちで好ましいものは、スルホコハク酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩およびポリオキシアルキレンアルキルアリールエーテルである。

本発明における分散剤(W)としては下記の分散剤があげられる。

(1) ポリビニルピロリドン

(2) ポリエチレングリコール

分子母が通常 1000~10 万、好ましくは 1000 ~2 万のもので特願昭 6 0 - 4 6 9 6 3 号明細書に記 私のものが使用できる。

(3) カルボン酸(塩)蓋、アミノ蒸、水酸基、エーテル基、アミド蒸および第(級アンモニウム塩 基からなる群より選ばれる基を含有するモノエチレン性不飽和単量体を必須構成分とする水溶性量 合体。

重合脂肪酸とポリアミン(ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミンなどのポリアルキレンポリアミンなど)とのポリアミドでアミン価が通常100~700、好ましくは200~500 のものなど。

(3) ポリアミド、窒素含有有機化合物、多価アルコール等の A U 付加物で水溶性のもの。

AOとしては炭素数 2~4のアルキレンオキサイド(EO、PO、プチレンオキサイドなど)があげられる。

具体的にはポリアミドのポリオキシアルキレン 誘導体(特公昭 51-44276号公報)、イオウ含有 ポリアミドのポリオキシアルキレン誘導体(特公 昭 57-43199号公報)、ポリアルキレンポリアミ ンのポリオキシアルキレン誘導体(特公昭 58 -21958号公報)、アンモニア、モノアミン、設 アミドなどのポリオキシアルキレン誘導体(特別 昭 54-116565 号公報)、少なくとも5 個の アルコールのポリオキシアルキレン誘導体(特別 昭 64-105653 号公報)があげられる。 特頭昭 60-61415 号明網に記載のものが使用できる。たとえば以下の記載の単独または共重合体があげられる。

重合体 No. 1: アクリル酸 / 2 - ヒドロキシエチルメタアクリレート / メチルアクリレート (73:26:1) 共重合体のナトリウム塩。

重合体 No. 4: アクリル酸/2-ヒドロキシエチルメタアクリレート (70:30) 共重合体のトリエタノールアミン塩。

重合体No.5:マレイン酸/アクリル酸/2-ヒドロキシエチルメタアクリレート(30:60:10)共重合体のトリエタノールアミン塩。

(4) 重合脂肪酸ポリアミド

分散剤(A)のうち好ましいものはポリビニルピロリドン、ポリエチレングリコールおよび(3)に記載した水溶性蛋合体である。

本発明におけるダイヤモンド砥粒は天然から得られたものでも、また人工的に合成されたものでもよい。その平均粒径は通常 20 μ 以下好ましくは 10 μ 以下である。平均粒径が 20 μ より大きいものは、研磨所要時間は短縮されるが研磨加工画の表に対位を使用した加工をで再度研磨加工する必要がある。また水中に安定に分散させることが困難である。

本発明の加工液には必要により添加剤を加える
ことができる。このような添加剤としては防清、
防食剤にとえば有機アミン、シクロヘキシルアミン、モルホリンなど)、有機アミン誘導体で、アミンのアルキレンオキシド付加物、脂肪酸(カフミンの、脂肪族または芳香族カルボン酸(カロ・カル酸、安息香酸など)およびこれらカルボン酸、安息香酸など)およびこれのカルボン酸

のアルカリ金属塩、アミン塩など、PH調整剤たとえば上記アミンやアルカリ金属の水酸化物など、および消泡剤たとえばシリコーン化合物やポリエーテル化合物などをあげることができる。

本発明の加工被の処方を示せば下記の通りである。

( %は加工液の重量に対する%である。

分散剤(A) 通常 0.1~5 0% (好ましくは 1~3 0%) 浸透剤(B) 通常 0.1~2 0% (好ましくは 0.1~5%) ダイヤモンド砥粒

通常 0.1~10%(好ましくは 0.2~5%)

上記において分散剤の含有量が 0.1 より少ないとダイヤモンド砥粒を水中に安定に分散させる効果が小さくなり、また 50%をこえると加工液の粘度が高くなり取扱いにくい。

浸透剤の含有量が 0.1 より少ないと加工液のねれ性、展着性が不十分でダイヤモンド価粒を研磨 加工材へ十分供給できない。また、 20% を越えて

レス、アルミニウム、銅、ニッケルなど)、プラスチック(ナイロン、ポリアセタール、ポリカーボネート、変性ポリフエニレンオキサイドなど)、ガラスおよびこれらの複合材料(セラミックーフエライトなど)があげられる。

このような被研磨材料は一般に従来より用いられているラッピングマシン(日本エンギス社製、スピードファム社製、ワシノ機械製、不二越機械工業製)などで研磨される。

本発明の加工液の適用法は、従来の加工液の適用法と同様でよく、たとえば研磨加工においてラッププレートに加工液を適下またはスプレーすればよい。

#### ( 実施例)

以下実施例により本発明をさらに説明するが本 発明はこれに限定されるものではない。 実施例中 の名は置量基準である。

#### 英施例1~8

本発明の加工液(実施例1~8)を表-1の通 り作成した。参考品(参考例1~4)も表-1に も添加しただけの効果は認められない。

ダイヤモンド低粒の含有量が 0.1 % より少ない と研璃所要時間が長くなり、また 10% をこえる と被研遊材料表面の端ダレ量が大きくなり、 緑加 しただけの効果はみられず経済的に不利である。

本発明の加工放の製造は、あらかじめ分散剤および浸透剤溶解させた水にダイヤモンド低粒を合して攪拌により分散させる方法でも、また、分散剤、浸透剤、水およびダイヤモンド低粒をののに配合して攪拌により分散させる方法でもよい。

応分散させた後でも、またこれら4成分と同時に加えて溶解させてもよい。

機样方法としてはマグネチックスターラー、羽根式機样機、ホモミキサーなどを用いる方法があげられるがいずれの方法によつて機伴してもよい。 また必要に応じて提拌時加熱をしてもよい。

本発明の加工液が用いられる被研磨材料としては、 セラミツクス ( 硅石系、アルミナ系、 炭化ケイ素系、 窒化ケイ素系など )、 金属 ( 矧、ステン

示す。

- 表 -

		4	*1	5	散	和 *2	8	坊		
		水	粒	1	D	Д	1	Q	10	坊 清 荊
	1	9 5.5 %	1	2.5	0	0	1	0	0	0
実施	2	9 5.0 %	1	2.5	0	0	0.5	0	0	1
	3	9 4.5 %	1	2.5	0	0	1	0	0	1
	4	9 0.5 %	1	2.5	0	0	5	٥	0	1
	5	9 4.5%	1	2.5	0	0	O	1	0	1
	6	9 4.5 %	1	2. 5	U	0	0	0	ī	1
	7	9 4.5 %	1	0	2.5	0	1	0	0	1
	8	9 1.0 %	1	0	0	6.0	1	0	٥	1
#	1	9 6.5 %	1	2.5	0	0	0	0	0	0
考例	2	9 5.6 %	1	2, 5	0	0	0	0	0	1
	8	9 5.5 %	1	0	2. 5	0	0	0	0	1
	4	9 2.0 %	1	0	0	6.0	0	0	0	1

# 1 低粒 : ダイヤモンド低粒 ( 平均粒径 0.5 μ )

+2 分散剤【:ポリピニルピロリドン(和光純薬

工業製化粧品用 K-80)

Ⅱ:ポリエチレングリコール(三洋化

成工業製 PEG 4000(平均分子量 4000))

□: 重合体№1 (約40%水烙液)

(注・蛋合体 % 1 は 前記分散剤 (A)

の項で説明した。

\* 8 及透剤【:ジオクチルスルホコハク酸エステ

ルナトリウム塩

□:ドデシルベンゼンスルホン酸ナト

リウム塩

旦:ノニルフエノールEOM

本発明の加工液(実施例1~8)および比較品として市販の加工液(比較例1~3)を用いて行なった経時安定性結果を表~2に示す。

なお比較例1 および 2 は、いずれも平均拉径
0.5 m のダイヤモンド砥粒を 1 %含有する水を分散
磁とした加工液である。比較例 3 は特開昭 5 5 ~
1 8 9 4 7 9 号公報の発明の詳細な説明に記載されて
いる加工液の組成(粒径 0.0 8~0.1 m の酸化マグネ
ンウムをグリセリンと水の混合液に加えたもの)
に準じて、酸化マグネシウムの代りに平均拉径
0.1 m のダイヤモンド砥粒を使用し、ダイヤモンド
低粒 1.0%、グリセリン 2.5% および水 9 6.5% の割合

3に示す。

表 - 8

項目		実 施 例									参考例			
74 F	١ ١	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	а	4	
接触角*	<b>4</b> (°)	17	17	15	10	17	17	15	15	75	20	20	20	
ひろがり性	5	2.3	2.2	2.5	3.5	2.3	2,8	2.5	2.5	0.9	1.5	1.5	1.5	
施れ性	6 <del>(24)</del>	7.5	7	8	10	7.5	7.5	8	8	0	3.5	4	3.5	

- + 4 接触角は銅板に対する加工液の接触角を示す。
- ・5 ひろがり性は水平な鍋板上に加工液を 0.1 me 滴下したときの加工液の鍋板上での直径を示す。
- \*6 流れ性は銅板を水平より 30° 傾け、その上方から加工液を 0.1mℓ 満下したとき、加工液が 銅板上を流れる距離を示す。

(注・この実験で用いた銅板は JIS H8100 に 規定された材質 C1100P のもの。)

表~3の結果から本発明の加工液は研磨材料へのぬれ性および展着性が振めて良好であることがわかる。

で混合したものである。

表 - 2

静置時間			比	較	例						
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	8
0 時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	۵	×	×
2	0	O	0	0	0	0	0	0	×	×	×
5	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×
10	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×

経時安定性試験は各加工被を窒息で静蔵し分散 状態を肉银で観察した。なお、表 - 2 中の記号は 次の通りである。

〇:均一に分散

ム:やや分離

×:分離

表 - 2 の結果から本発明の加工板は分散安定性が極めて良好であることがわかる。

本発明の加工液および参考品(参考例 1 ~ 4 ) の研磨材料へのねれ性および展養性について去 --

#### ( 発明の効果)

本発明の加工液は下記の効果を奏する。

(1) 加工被の分散安定性がよく、経時的に延拉が 沈降しにくい。この結果一定量のダイヤモンド延 拉を被研摩材に安定に供給できるため作業性が向 上する。さらに延拉が経時的に沈降しにくいため、 延粒の含有量が少ない加工液が被研摩材に供給 され研摩所要時間が及くなつたりすることがなる。 加工液を供給する前にあらかじめ提择混合する必 要もなく、作業性を著しく改善させる。

(2) 研摩材料へのぬれ性および展着性に極めて受れるため使用する加工液が少なくですみ、経済的に優位である。

(3) 分散剤の含有量および分子量を変えることにより低粘度の加工液から高粘度の加工液まで目的にあわせたものを使用できる。

(I) 高品質、高精度の研密加工面を得ることがで さる。

⑤ 水を分散媒にしているため火災の危険性がない。

(6) 被研磨材料から加工液の除去が容易である。 (7) 本発明の加工液はセラミック、金属、ガラス、 プラスチックなどの材料の表面研密に有用である。 (8) 低粒そのもののもつている特性を損うことが ない。

上記効果を奏することから、本発明の加工液は 電子部品分野の著しい進歩に伴い望まれてきてい る電子部品材料の高品質、高精度の表面研磨加工 に有用である。

符許出細人 三洋化成工業株式会を



(1)明鵠遊第1頁の発明の名称の題の「研摩加工波」を「研磨加工波」に訂正する。

(2) 同書第1~第2頁の特許請求の範囲を

- 「1. 水溶性高分子分散剤(A)、慢速性界面活性剤(B)、水およびダイヤモンド砥粒を含有することを特徴とする研磨加工液。
- 2. (B) の含有量が加工液の重量に基いて 0.1~20%である特許請求の範囲第1項記載の 加工液。
- 3. (B) がスルホコハク酸エステル塩、アルキルペンゼンスルホン酸塩、(アルキル)ナフタリンスルホン酸塩のホルマリン縮合物、アルカンスルホン酸塩のホルマリン縮合物、アルカンスルホン酸塩、アルキル領酸エステル塩といるでは、ボリオキシアルキレンアルキルアリールエーテルからなる評よりでは、アルキレンアルキルである特許請求の範囲第1項または第2項記載の加工液。
  - 4. (A) の含有量が加工液の重量に基いて

手統剂正型

昭和60年8月29日

初節庁長官 宇 賀 道 郎 段

1. 事件の表示



ダクーノ8 415 Y 昭和60年8月21日提出の特許願

2. 発明の名称

研磨加工液

3. 雑正をする者

事件との関係 特許出駅人 住所 京都市東山区一個野本町11番地の1 名称 (228) 三洋化成工業株式会 1

代表者 前田常



4. 補正命令の日付 自 発

- 5. 補正により増加する発明の数 O
- 6. 植正の対象 明和書の発明の名称、特許請求の範囲および発明の詳細な説明 の各機
- 7. 補正の内容 別紙の通り。



0.1~50%である特許請求の範囲第1項~第3項のいずれか一項に配裁の数の加工被。

5. (A) が(1)ポリビニルピロリドン、②ポリエチレングリコールおよび/または(3)カルボン酸(塩)基、アミノ基、水酸基、エーテル基、アミド星および第4級アンモニウム塩基からなる群より選ばれる基を合有するモノエチレン性不飽和単異体を必須関成成分とする水溶性重合体である特許請求の範囲第1項~第4項のいずれか一項に記載の数の加工液。」

と訂正する。

(3)下記の箇所の「研律」を「研磨」に訂正す -

ð.

Ā	2	2	2	3	3	3	16	17	18	18
行	12	14	20	3~4	4	9	20	18	5	7

頁	18	18
行	8	11

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.